高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术



作者:徐传骧主编

出版社:北京:机械工业出版社

出版日期: 1981.11

总页数: 206

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10533416.html) 查找全本阅读方式

高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10533416.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10533416.html

书名: 高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术